

委託費支出明細書

1. 委託費の名称	平成22年度戦略的基盤技術高度化支援事業(半導体デバイス製造工程における回転霧化式エアロゾルスプレーによる成膜装置の開発)	
2. 事業の目的及び内容		
(1) 目的	小型化、高性能化を実現する3次元スタック構造の半導体デバイスにおいて、配線と層間配線を同時に形成するデュアルダマシン法を使った貫通電極形成のニーズがある。デュアルダマシン法では、直径数十μm、深さ数百μmの孔壁面にレジストを成膜する必要があるが、その技術は確立されていない。 本事業では、この技術確立ためレジストを微小液滴化し孔壁面に成膜を可能とする回転霧化式エアロゾルスプレー式の成膜装置を開発する。	
(2) 具体的な内容	①成膜装置の試作開発 ②成膜装置の評価 ③プロセスの研究開発 ④SEMI規格および安全規格の審査 ⑤川下ユーザでの生産プロセスでの評価	
3. 委託先の公益法人の名称	財団法人名古屋産業科学研究所	
4. 委託費支出実績額	93,557千円(A)	
5. 委託費における管理費		
(1) 人件費	2,104千円	
(2) 一般管理費	6,180千円	
(3) その他の管理費		
	内容	金額
		0千円
		0千円
	合計	0千円
	合計	8,284千円
6. 外部への支出		
(1) 外部に再委託されているものに関する支出		
	支出内容	支出先
	再委託費	株式会社旭サナック
	再委託費	国立大学法人九州大学
		0千円
		0千円
	合計	20,375千円(B)
(2) (1)以外の支出		
	支出内容	支出先
	機器設備費	旭サナック株式会社 他
	事業費	三菱UFJリース株式会社 他
		0千円
		0千円
	合計	64,895千円
7. その他		
	内容	金額
	消費税及び地方消費税	0千円
		0千円
	合計	0千円
8. 再委託の割合	21.7 % (B/A)	